<特集>

レーザイオン化 TOFMS 法を用いたガス中 PCB モニタリング装置開発

Development of PCB Real Time Monitor Using Laser Ionization Time of Flight Mass Spectrometry

吉良雅治¹,田中隆一郎²,猪澤祥規²,○出口祥啓³, 土橋晋作³,篠田克彦³,森田昌敏⁴

1 三菱重工業株式会社本社環境ソリューション部 ² 三菱重工業株式会社長崎造船所 ³ 三菱重工業株式会社長崎研究所* ⁴ 国立環境研究所

Masaharu Kira¹, Pyuichiro Tanaka², Yoshinori Izawa², Yoshihiro Deguchi³, Shinsaku Dobashi³, Katsuhiko Shinoda³, Masatoshi Morita⁴ ¹Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Machinery Headquarters, Environmental Systems Department ²Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Nagasaki Shipyard & Machinery Works ³Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Nagasaki R & D Center ⁴(IAI) National Institute for Environmental Studies

Abstract

This study demonstrates the applicability of PCB monitoring using laser ionization time of flight mass spectrometry. Picosecond 266nm laser light ionization reduced fragmentation, with PCB detection sensitivity under ppdv ($\sim \mu g/Nm^3$) that can be achieved in one minute detection time. This has great advantages in terms of real time monitoring ability compared to the conventional method, which requires several days analysis time. A prototype of the PCB monitoring device has been developed and tested in Mitsubishi Heavy Industries' PCB treatment plant. The one-minute detection time represents a substantial advance in the monitoring of exhaust gas and in compliance with safety regulations in the atmosphere surrounding work areas where PCB vessels are dismantled.

Key Words : Laser, Time of Flight Mass Spectromentry, Ionization, PCB, Trace Element, Monitoring

1 はじめに

PCB(ポリ塩化ビフェニール)は,芳香族塩素化合物 の一種であり,1970年以前にはコンデンサなどに広く使 用されていたが,生体や環境への影響が指摘され,1972 年に製造禁止,1974年にその新規使用が禁止された.現 在,2001年7月15日に施行されたPCB処理特別措置法 により,PCB分解処理が法的に義務付けられ,多くの企 業,研究機関でPCB分解処理技術が研究開発されてき ている.近年, PCB 処理プラントが計画・稼動されよう としており, 三菱重工業(株)でも PCB 水熱分解装置を 開発し, 2000年12月より PCB の自家処理を開始してい る.PCB 処理では, PCB の液処理, PCB を内蔵してい る容器の洗浄処理,紙・木などの内容物の処理が必要と なる.分解処理時に生成する排ガスや,容器処理の作業 環境下において,周囲環境への漏洩や作業者への曝露が 無いことを確認する必要がある.公定分析法では,ガス サンプリング及び濃縮分析に, 2~3 日以上の時間が必要 となり,安全管理上,より迅速な PCB モニタリング装置 の開発が求められていた.

^{*〒 851-0392} 長崎県長崎市深堀町 5-717-1 TEL:095-834-2322 FAX:095-834-2165 E-mail:yoshihiro_deguchi@mhi.co.jp

本研究では,排ガス,作業環境大気を対象に PCB を1 分以内で計測可能な装置開発を目指し,ガス直接導入式 レーザイオン化 TOFMS 法(Time of Flight Mass Spectrometry,飛行時間型質量分析法)¹⁾を新たに開発した. 本方法では,ピコ秒レベルの短パルスレーザ光を用いて, PCB のイオン化効率を向上させると共に,イオントラッ プ技術を用いて,選択性を向上させ,排ガスの管理目標 値:0.15mg/Nm³の1/10以下の0.01mg/Nm³の検出感 度を達成した.また,本技術を用いた PCB モニタリング 装置を試作し,三菱 PCB 水熱分解自家処理パイロット プラントにおいて,PCB モニタリング性能を実証し,実 用化の目処を得た.

2 PCB 計測原理

本研究では,排ガス直接導入式レーザイオン化 TOFMS 法を使用した.本手法は,塩素化炭化水素やダイオキシ ン類の高感度検出法として,近年開発が進められてきて いる²⁾⁻⁴⁾.Fig.1 にレーザを用いた共鳴多光子イオン化 原理を示す.



Fig.1 共鳴多光子イオン化過程のエネルギ遷移

PCBのような環状分子は,特定波長,特に250~300nm の紫外光を吸収し,高エネルギー準位に励起する.レーザ 光のようにエネルギー密度の高い光が入射した場合,励 起された分子は,さらに光を吸収しイオン化する.本原 理を用いて PCB をイオン化し,飛行時間型質量分析法 にて PCB を他の不純物と分離検出する.

従来, PCBのような塩素化炭化水素の計測には, 超音 速ジェットを利用した共鳴多光子イオン化法が利用され ていた²⁾⁻⁴⁾.この方法は,計測対象を超音速ジェットで 極低温に冷却し,分子を特定準位に集めることで共鳴イ オン化波長を限定させ,選択性向上と高感度化を達成し ていた.しかしながら,この方法では,塩素数が増える と共鳴準位が解離準位と重なりやすく,分解が支配的と なり,計測感度が低下する欠点が存在した.

本研究では,ダイナミックトラッピング法を組み合わ せたイオントラップ型 TOFMS 法⁵⁾⁻⁸⁾を適用した計測 法を開発した.Fig.2 にイオントラップ型 TOFMS 法の 構成を示す.



Fig.2 イオントラップ TOFMS システムの概観図

レーザイオン化では,高塩素 PCB における解離過程 を低減するため,ピコ秒レベルの短パルスレーザ光を使 用した.短パルスレーザ光の使用により,分解より早く 共鳴イオン化が生じるため,分解による感度低下を抑制 できる^{9,10)}.

生成したイオンはイオントラップ内へと導入される. イオントラップ内のイオンは,一定時間保持された後, TOFMS チャンバへと加速放出される.生成するイオン の質量をm,イオン飛行距離をL,飛行時間をt,加速 電極の電位ポテンシャルV,zをイオン化数とすると,エ ネルギー保存則により次式が成立する.

$$zV = \frac{1}{2}m\left(\frac{L}{t}\right)^2, m = \frac{2zV}{L^2}t^2 \tag{1}$$

式(1)より,検出器側に到着するまでの飛行時間とイ オン信号強度を計測することで,生成するイオンの質量 と数密度が計測可能となる.

3 PCB モニタリング装置構成

本研究で使用した PCB モニタリング装置プロトタイ プ装置構成を Fig.3 に,装置写真を Fig.4 に示す.

PCBのイオン化には,波長 266nm,パルス幅 150psの レーザ光を使用した.計測では,レーザ光を 10Hz で発振 し,試料導入部に照射して試料をイオン化させる.生成



Fig.3 プロトタイプ機の装置構成



Fig.4 PCB モニタリング装置写真

したイオンは,イオントラップ内に導入され,一定時間 保持された後,TOFMS チャンバへと放出され,イオン 検出器へと導入される.検出器に入射したイオンは,イ オン検出器にて電流出力となり,プリアンプによって増 幅された後,イオンカウンタによってデジタル化されて コンピュータ上にデータとして保存される.

イオントラップ装置にはヘリウムを供給できる機構と なっている.これはヘリウムを導入することにより,ト ラップイオンの冷却を図り,イオン放出の際にイオンを トラップ内の中心に閉じ込めることによって、シグナル の時間分解能を向上させることを狙いとしている.

PCB 標準試料生成には,気体搬送方法を採用した PCB 校正ガス発生装置を使用した.PCB は一定温度に保たれ た容器内に封入し,蒸気圧分に対応する PCB を窒素で搬 送し,装置内部へ導入した.本装置では,発生する PCB を希釈することで,0.01~1mg/Nm³(塩素数により搬送 される PCB 濃度は異なる)の PCB 標準試料を生成する ことが可能である.

4 プロトタイプ機を用いた検証試験

4.1 PCB 標準ガス計測

Fig.5 にレーザイオン化 TOFMS 法を適用し, PCB 校 正ガス発生装置より導入した PCB を計測した結果を示す.



Fig.5 PCB 質量スペクトル例

用いた試料は PCB 標準試料 KC-300 であり,2~4 塩 素 PCB が主要成分となっている.本装置では,計測時間 は1分間とし,測定ガス中に内部標準ガスとして一定量 の2,4-ジクロロトルエンを混入させ,2,4-ジクロロト ルエンと PCB のイオンシグナル強度の比より,各 PCB 濃度を算出した.また,各 PCB 濃度は,本校正ガスを サンプリングして溶媒吸収させた後¹¹⁾,GC-MS分析よ リ求めた.PCB 校正容器を35°C とした場合には,2~4 塩素 PCB に関し,PCB 濃度はそれぞれ0.20,0.69 およ び 0.16mg/m³N であった.横軸は質量数を示し,縦軸は イオンシグナル強度を示す.図に示すとおり,2~4 塩素 PCB が良好に計測できていることを確認できた.

Fig.6に本試験装置を適用した PCB 標準ガス計測結果 を示す.

ー定量の PCB を含むガスを本装置内に導入した場合, 2 時間の計測時間内(計測時間:1分,計測点数:120 点)において,計測される PCB 濃度は標準偏差 5%で 一定の値を示した.また,「ガスサンプリング+GC-MS」分析結果と本装置の計測結果は良い比例関係を 示し,標準偏差で 30%以内の一致を示すことが確認で きた.各塩素数の検出限界は1分間,S/N=3 換算で 2 塩素 PCB で 0.00011mg/Nm³(約 10pptv),3 塩素 PCB で 0.00048mg/Nm³(約 40pptv),4 塩素 PCB で 0.00080mg/Nm³(約 60pptv)となり,PCB 濃度:





(a) 3 塩素 PCB の計測安定性

(b) GC-MS 分析との比較結果

 $0.01 \mathrm{mg/Nm^3}$ の感度は十分に達成できることを確認できた.

4.2 PCB 自家処理プラント排ガスへの適用結果

三菱重工業(株)長崎研究所に設置されている PCB 自 家処理プラントに PCB 計測室を新たに追設し,本研究 にて開発した排ガス中 PCB モニタリング装置を設置し た.Fig.7 に自家処理プラント写真を,Fig.8 に自家処 理プラントでのサンプリングライン系統図を示す.

Fig.9にPCB自家処理プラントでの実証結果例を示す.

自家処理プラントを構成する PCB 水熱分解プラント の排ガス及び容器処理プラントの作業環境大気を多点サ ンプリングシステムで吸引し,ガス中 PCB モニタリン グ装置 (Fig.4) にて計測した結果である.横軸は時間, 縦軸は PCB 計測濃度を表す.Fig.9 (a) に示すように,







Fig.8 多点サンプリングシステム系統図

排ガス中 PCB 濃度が低い場合には,本装置の計測値は 0.01mg/Nm³ 以下の値を示しており,「ガスサンプリン グ+GC-MS」による計測結果:0.001mg/Nm³とも一致 している.排ガス中の PCB 濃度が比較的高い場合には (Fig.9 (b)),3 塩素 PCB は 0.1~0.2mg/Nm³,4 塩素 PCB は 0.01~0.02mg/Nm³ の計測値を示しており「ガス サンプリング+GC-MS」による分析結果(3 塩素 PCB: 0.19mg/Nm³,4 塩素 PCB:0.02mg/Nm³)と良い一致 をみた.また,作業環境大気中の PCB 濃度は管理目標値 0.15mg/Nm³を大きく下回ることがリアルタイムにて確 認でき,本装置が作業環境のの安全性確保に極めて有効 であることを実証できた.

上記のように,本装置は PCB 処理プラントの実ガス においても,共存物質などの影響なく PCB 計測が可能 であることを確認することができ, PCB ガスモニタリン グとしての実用化が達成できた.



PCB 処理装置から排出される排ガス中の PCB モニタ リングを目的に,短時間にて自動計測が可能な装置を開 発し,以下の成果を得た.

- ガス中 PCB に対し,波長 266nm の固定波長ピコ秒 レーザを用いたダイナミックトラッピング法を独自 開発し,計測時間1分,計測感度 0.01mg/Nm³を達 成した.
- PCB 自家処理設備に本 PCB モニタリング装置を適用し, PCB 処理工程の実ガス計測が可能であることを実証できた.

本装置は,世界初のリアルタイム PCB モニタリング装 置として,北九州 PCB 廃棄物処理施設,東京 PCB 廃棄 物処理施設にて実機採用されることが決定しており,今 後,実フィールドでの安全管理機器として広く活用を図っ ていく予定である.

[参考文献]

- D. M. Lubman, "Lasers and Mass Spectroscopy", Oxford Univ. Press., 1990.
- 2) 出口, 土橋, 燃焼研究, 119, p.37, 2000.
- 3) D. S. Zakheim, et al., Chem. Phys., 46, p.263, 1980.
- 4) U. Boesl, J. Chem. Phys., 95, p.2949, 1991.
- 5) R. D. March, "Quadrupole Storage Mass Spectrometry", JOHN WILLEY & SONS, 1989.
- 6) R. G. Cooks, et al., Acc. Chem. Res., 23, p.213, 1990.
- 7) R. E. Mather, et al., Int. J. of Mass Spectrom. Ion Processes, 33, p.201, 1980.
- 8) G. C. Eiden et al., Int. J. of Mass Spectrom. Ion Processes, 136, p.119, 1994.
- 9) J. Matsumoto, et al., Anal. Chem., 69, p.4524, 1997.
- 10) Y. Deguchi et al., Environmental Science and Technology, Vol. 37, Issue 20, p.4737, 2003.
- 11)(財)日本分析化学研究所「PCBの分析方法と解説」,科 学新聞社,1973.





Fig.9 PCB 自家処理プラントでの実証結果

- (a) 水熱分解プラント(低濃度時) 排ガス計測結果
- (b) 水熱分解プラント(高濃度時) 排ガス計測結果
- (c) 容器処理プラント作業環境大気計測結果